

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «20» 02 2026 года

№ 68.18-06-01-2026

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института перспективных систем передачи данных по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2025/2026 учебного года (Приложение).

Директор ИПСПД



(личная подпись)

А.Е. Романов

(ФИО)

68.18-06-01-2026

Приложение к распоряжению № _____ от " 20 " 02 2026 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
<p>Комиссия №1 председатель: Смирнова И. Г. секретарь: Матвеева М.В.</p> <p>члены комиссии: • Беляков Н.А. • Ковалев А.В. • Мынбаев К.Д. • Ширяев Д.С.</p>	Заседание №1 03.03.2026, 11:00, ZOOM	Конструирование элементов систем передачи данных	КЭСД F4273 1.1.1
	Заседание №2 13.03.2026, 11:00, ZOOM	Лазерные коммуникационные технологии	L3416, L3417
	Микропроцессорная техника	MT F4273 1.1.1	
	Нелинейная оптика в волоконных системах	НОВС L34 1.1	
	Оптические явления в полупроводниках	L3416	
	Основы оптических приемопередающих устройств	ООППУ F4173 1.1	
	Основы передачи данных	L3416	
	Передача информации и модуляция сигналов	ПИМС L34 1.1	
	Перспективные системы передачи данных	ПСД F4273 1.1	
	Производственно-технологическая	Пр_Т F4273	
	СВЧ-электроника	СВЧЭ F4273 1.1	
	Современная оптика	СО F4173 1.1	
	Современные лазерные и синхротронные технологии	СЛСТ F4173 1.1	
	Современные тенденции развития систем передачи данных	СТРСД F4173 1.1	
	Статистическая физика	L3417	
	Устройства генерирования, формирования, приема и обработки сигналов	L3416	
	Физика полупроводников	L3416	
	Физические основы проектирования оптоэлектронных приборов	ФОПОП F4273 1.1	
Физическое материаловедение	L3316		
Фотокаталитические материалы и процессы	ФМП F4273 1.1		